

# GW28 半導体産業用圧力計

Model GW28 Pressure Gauge for Semiconductor Industry

## 概要/DESCRIPTION

半導体高純度ガス、及び腐食性ガスの雰囲気等の条件下でも優れた性能を発揮します。

気密性・洗浄度に対しても充分考慮して製作されており、半導体プロセス等、特に高純度流体向けに適した圧力計です。

This pressure gauge demonstrates an excellent performance even under severe conditions, such as measuring in semiconductor gases of high purity or in a corrosive atmosphere. Being well-designed for leakage and cleanliness, this is adequate for the application, such as for semiconductor process lines and under high purified fluids.

## 特長/FEATURES

- ・φ28サイズの径タイプのため、集積化マウントの省スペース化に貢献できます。
- ・従来品（小型ブルドン管式）に対して接ガス部内容積は、約1/2となりガスが滞留するデッドスペース（接ガス部内容積）が大幅に低減されています。
- ・接ガス部は、従来のC形ブルドン管に比べ、単純なダイヤフラム式であるため、洗浄やガスフラッシングが容易に出来る構造です。

Being a small diameter, 28mm in size, this model will contribute to space-saving in an integrated mounting system. This model has seen a reduction of about a half of the gas trapping space (dead-space) in comparison to the bourdon tube type models. Since the gas contact part of a GW28 is simply of the diaphragm, unlike a conventional C-shaped bourdon tube, an easy cleaning and a gas flushing are available to a user.

※ 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう常用使用圧力が圧力レンジの30～65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定して下さい。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。

\*Please allow 30～65% of the full scale as the normal working pressure range for the gauge to display its best performance.

\*Please make sure, also, that the materials of the wetted parts are suitable for fluid that is to be measured.



## 製作仕様/SPECIFICATION

### 測定流体：Measuring fluids:

気体又は液体 Gas or Liquid

### 形状：Mounting:

埋込形... Panel mount... D枠（中心裏ネジ、ステム）  
center back stem

### 大きさ：Dial size:

φ28

### 接続ネジ：Connections:

1/4VCR (M)、1/4VCR (F)、1/4UJR (F)

### 接液部材質：Wetted parts material:

ダイヤフラム・株 EPグレード：SUS316L EP Grade：SUS316L  
Diaphragm, Socket BAグレード：SUS316L BA Grade：SUS316L

ケースCase SUS304 (生地) SUS304 (Plain)

内機Movement SUS製 Stainless steel

### 溶接方法：Welding:

アルゴンアーク溶接 Argon arc welded

### 圧力レンジ：Pressure range:

－0.1～0.2MPa

－0.1～0.4MPa

－0.1～1MPa

### 許容最大圧力：Max. allowable pressure

圧力レンジの1.0倍 100% of pressure range

### 使用温度範囲：Operating temperature:

－5～40℃

### 精度：Accuracy:

±3%F.S.

### 気密性(He真空法)：Leakage(Helium Leak rate):

$1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 以下  $1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$  or less.

### 清浄度：Cleanliness:

E Pグレード：0.2μm以上のパーティクル10個以下  
EP grade: Less than 10 particles with the diameter 0.2μm or larger.  
BAグレード：クラスIV (ANSI B40、1M-1979)  
BA grade: Class (ANSI B40、1M-1979)□

## 構造/PRINCIPLE AND CONSTRUCTION



